

微小領域測定 X 線光電子分光装置^{*1}

山下 孝子^{*2} 鈴木 敏子^{*3} 清水 真人^{*4}

Small Area X-Ray Photoelectron Spectroscopy

Technical Note

Photoelectron Spectroscopy

Microscopic Observation

Surface Analysis

Elemental Analysis

Elemental Composition

Elemental Distribution

Elemental Depth Profile

Elemental Identification

Elemental Quantification

Elemental Mapping

Elemental Microanalysis

Elemental Microscopy

Elemental Microspectroscopy

Elemental Microimaging

Elemental Microprofiling

Elemental Microcomposition

Elemental Microdistribution

Elemental Microidentification

Elemental Microquantification

Elemental Micromapping

Elemental Micromicroscopy

Elemental Micromicrospectroscopy

Elemental Micromicroimaging

Elemental Micromicroprofiling

Elemental Micromicrocomposition

Elemental Micromicrodistribution

Elemental Micromicroidentification

出された光電子の運動エネルギーを測定することによって、表面を

構成する元素の束縛エネルギーを知ることができる。情報の深さは



Table 1 Specifications of Small Area XPS, XSAM-800

Item	Specification
入射 X 線の面積	アパーチャーを併用することによって分析面積を限定する。これは、入射 X 線の面積が大きいために、レンズ系の焦点の裾から入る

この場合の分析面積は、エッジナイフによるプロファイルから 153

mm²であった。